

SYSTÈME DE MAINTIEN D'ÉCHANTILLON

FICHE N° 16018

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Japan Electron Optics Lab.

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique

Description

Le système de maintien d'échantillon fabriqué par Japan Electron Optics Laboratory est constitué d'un axe métallique dont une extrémité est munie d'une poignée sphérique en plastique noir. Cet axe traverse un ensemble de deux pièces métalliques dont une servant à insérer l'objet dans un microscope électronique. L'axe se termine par un embout métallique formant un crochet à quatre branches sur lesquelles fixer un échantillon.

Le système de maintien d'échantillon est le support sur lequel positionner l'échantillon pour une observation. L'objet à observer est maintenu sur l'embout de l'axe et le système est vissé dans le microscope électronique à la place qui lui revient. La poignée permet de déplacer l'objet dans et hors du faisceau d'électrons.

Utilisation

Cet objet a été utilisé dans la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin dans des travaux de mesure, de recherche et de développement.

Il était lié aux microscopes électroniques à transmission acquis par Michelin.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Système de maintien d'échantillon (Japan Electron Optics Lab.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33876>, consulté le 2026-07-22